

第26回キャラクターゼーション講習会プログラム

「触媒および表面の解析に役立つキャラクターゼーションの基礎と実際」

主催 触媒学会

協賛 日本化学会，石油学会，表面科学会，ナノ学会

日時 平成 28 年 12 月 6 日 (火)

会場 大阪工業大学 大宮キャンパス研修センター 5F
〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1

(https://www.oit.ac.jp/japanese/oit/access_omiya.html)

参加費 主催・協賛団体会員 4,000 円，非会員 6,000 円，学生 1,000 円

プログラム

13:00-13:50 講演① 寺村 謙太郎 先生 (京都大学)

「X線吸収分光法によるin situでのナノ粒子生成過程の観察」

13:50-14:40 講演② 酒多 喜久 先生 (山口大学)

「赤外分光法による触媒表面上での化学過程の解析“測定法の基礎と条件下測定例”

14:50-15:50 ポスター発表

16:00-16:50 講演③ 古南 博 先生 (近畿大学)

「TEM/SEMを用いた固体表面のキャラクターゼーション：基礎から応用まで」

16:50-17:40 講演④ 池田 茂 先生 (甲南大学)

「太陽電池および水分解反応に用いる半導体薄膜における光電気化学測定の実際」

17:40-17:50 ポスター表彰式

18:00-19:30大阪工業大学 大宮キャンパス研修センター 5F (会費：2,000円)

【参加申込方法】

e-mail にて「キャラクターゼーション講習会参加申込」と題記し，(1)氏名，(2)所属（勤務先および部署等），(3)連絡先（住所，TEL, Email），(4)ポスター発表の有無（有の場合には題目，著者を明記，ポスター賞は学生のみ対象とします），(5)懇親会に参加または不参加，を明記の上，11月18日（金）までに下記連絡先にお申し込みください。

連絡先 〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1

大阪工業大学 東本 慎也 TEL: 06-6954-4283, Email: higashimoto@chem.oit.ac.jp

世話人：東本 慎也（代表，大阪工業大学），古南 博（近畿大学），酒多 喜久（山口大学），
市橋 祐一（神戸大学），亀川 孝（大阪府立大学），堀内 悠（大阪府立大学），